

เอกสารอ้างอิง

เจน สงสมพันธ์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 1. สถาบันอิเล็กทรอนิกส์ กรุงเทพมหานคร. ปทุมธานี 2537.

ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28 ว่าด้วยการบรรจุแก๊สปีโตรเลียมเหลว กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย, โรงพิมพ์ธรรมศาสตร์ 2535.

ศุภสโกข หมื่นสิทธิ พิสิกส์ของวัสดุ ศูนย์ส่งเสริมกรุงเทพสมิตรออฟเซท, กรุงเทพฯ 1992.

สรุปสภาวะธุรกิจ-อุตสาหกรรม 2538 และแนวโน้มปี 2539 บริษัท ปีโตรเคมีแห่งชาติ

C. XU, J. tamaki, N. Miura และ N. Yamazoe, Grain Size Effects on Gas sensitivity of Porous SnO₂ - based Elements, Sensors and Actuators, B 3(1991) 147 - 155.

F.J. Schmitte, Conductivity Behavior fo Thick film Tin Dioxide Gas Sensors, Sensors and Actuators, B 4(1991) 473 - 477.

Figaro Gas Sensor, Production Catalog, Figaro Engineering Inc. 1995.

G. Ghiotti, A. Chiorino, W.X. Pan และ L. Marchese, A Comparative study of SnO₂ and CrO_x, SnO₂ Powders : their microsture and their different response to CO, NO, H₂ and CH₄ atmosphers, Sensors and Actuators, B 7(1992) 691 - 699.

H.J. Beie, Oxygen Gas Sensors Based on CeO₂ Thick and Thin film, Sensors and Actuators, B 4(1991) 393 - 399.

G. Materinelli และ M. C. Carotta, Influence of Additive on the Sensing Properties of Screen Printed SnO₂ Gas Sensors, Sensors and Actuators, B 15-16(1993) 363 - 366.

G. Sberveglieri, Gas sensor : Principles, Operation and Developments, Kluwer Academic Publishers, Boston and London, 1992.

KTV. Gratton, Sensors Technology, System and Application Adarm Higer press, Bristol and Philadelphia, 1991.

Introduction to Cosmos Gas Sensor. New Cosmos Electric CO., Ltd. Japan.

K. Tanaka, S. Morimoto, S. Sonoda, S. Matsuura, K. Moriya and M. Egashira, Combustion Monitoring Sensor using Tin Oxide Semiconductor, Sensors and Actuators, B 3(1991) 247 - 253.

L.J. Golonka, J. Kozlowshi and B.W Liczenerski, The Influence of The Electrode Material on the Sensitivity of SnO₂ Thick - film Gas Sensor, Sensors and Actuators, B 18-19(1994) 453 - 456.

N. Taguchi, Jpn, Patent NO. 3,644,795

N. Murakami, K. Tanaka and K. Ihokura, US, patent NO. 4,459,577

P.D. Skafidas, D.S. Vlachos and J.N. Avaritsiotlis, Modelling and Simulation of Abnormal Behavior of Thick - film Tin Oxides Gas Sensor in CO, Sensors and Actuators, B 21(1994) 109 - 121.

P.T. Moseley and B.C. Tofield, Solid State Gas sensor, IOP Publishing Ltd. , Bristol and Philadelphia.

R.W. Vest, Materials Science of Thick - film Technology, Ceramic Bulletin, 65(4) 1986, 631 - 636.

T. Oyabu, Sensing Characteristic of SnO₂ Thin - film Gas sensor, J. Appl. phys., 53(4) 1982, 2785 - 2788.

W.F. Chu, V. Leonhard, H. Erdmann and M. Ilgenstein, Thick - film Chemical Sensors, Sensors and Actuators, B 4(1991) 321 - 324.

Y. Matsuura and K. Takahata, Stabilization of SnO₂ Sintered Gas Sensor, Sensors and Actuators, B 5(1991) 205 - 209.